УДК 548.4:539.12.04:535.343.2

## КИНЕТИКА ИОННО-ДИФФУЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ РАСПАДА РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ В ИОННЫХ КРИСТАЛЛАХ

### Арапов Б., Орозбаева А.А., Арапов Т.Б.

Ошский государственный университет, Ош, e-mail: baish-arapov@yandex.ru

В данной работе рассмотрена ионно-диффузионный механизм распада радиационных дефектов в ионных кристаллах. Предложено кинетическое уравнение, характеризующие скорости взаимодействия рекомбинационных частиц и ее решения, объясняющие одностадийные и многостадийные процессы распада радиационных дефектов.

Ключевые слова: ионно-диффузионные процессы, подвижные дефекты, радиационные центры, отжиг радиационных дефектов, кинетическое уравнение

# ION KINETICS OF DIFFUSION PROCESSES DECAY RADIATION DEFECTS IN IONIC CRYSTALS

### Arapov B., Orozbaeva A.A., Arapov T.B.

Osh State University, Osh, e-mail: baish-arapov@yandex.ru

In this paper we consider the mechanism of ion diffusion decay of radiation defects in ionic crystals. A kinetic equation describes the rate of recombination of particles, interacts and solves it, explains one-step and multi-step processes of radiation-induced defects decay.

Keywords: ion-diffusion processes, mobile defects, radiation centers, annealing of radiation defects, the kinetic equation

На основе экспериментальных результатов установлено, что при термическом распада радиационно-наведенных дефектов в ионных кристаллах играют ионные процессы, приводящие к превращению наведенных дефектов в другие менее устойчивые образования.

В радиационно-ионных процессах подвижные ионные дефекты имеют конечную длину свободного пробега, поэтому для определения кинетики распада центров следует использовать диффузионную теорию рекомбинации. На основе этой теории рекомбинации получено кинетическое уравнение радиационно-ионных процессов отжига радиационно-наведенных дефектов в ионных кристаллах [1–3].

Закономерности взаимодействия подвижных ионных дефектов и центров окраски определяется концентрацией подвижных дефектов *n*, их диффузии Д

энергией активации  $\varepsilon$ , концентрацией центров окраски N и температурой T.

Выразив n через N

$$n = N + (n - N) = N + \Delta m = \Delta m \left(\frac{N}{\Delta m} + 1\right),$$

где 
$$\Delta m = (n-N) = (n_0 - N_0)$$
 — разность концентрации подвижных ионных дефектов п и центров окраски  $N$ ), получим дифференциальное уравнение:

$$-\frac{dN}{dT} = 4\pi r_0 \beta^{-1} \prod N \left( \frac{N}{\Delta m} + 1 \right) \Delta m,$$

характеризующей скорость взаимодействия рекомбинирующих частиц, где  $\beta = \frac{dT}{dt} -$ скорость нагрева.

Решение этого уравнения будет иметь следующий вид:

$$N = N_0 \left[ \left( 1 + \frac{N}{\Delta m} \right) \exp(-4\pi r_0 \beta^{-1} \mathcal{A}_0 \Delta m \int \exp(\frac{\varepsilon}{kT}) dT \right] = -\frac{N_0}{\Delta m} \right]^{-1}.$$

Из этого уравнения были получены более простые случаи:

а) если  $\Delta m = n - N = n_0 - N_0 \approx n$ , (то есть, n >> N,  $n_0 >> N_0$ ), тогда получим одностадийные кривые термического отжига дефектов по реакции 1-го порядка:

$$N = N_0 \exp \left[ -4\pi r_0 \beta^{-1} \mathcal{A}_0 n_0 \int_{T_0}^{T} \exp \left( -\frac{\varepsilon}{kT} \right) dT \right].$$

б) если  $\Delta m = n - N = n_0 - N_0 = 0$ , (то есть, n=N,  $n_0$ = $N_0$ ), тогда получим одностадийные кривые термического отжига дефектов, но по реакции II порядка:

$$N = N_0 \left[ 1 + 4\pi r_0 \beta^{-1} \mathcal{A}_0 n_0 \int_{T_0}^{T} \exp\left(-\varepsilon / kT\right) dT \right]^{-1};$$

в) если  $\Delta m = n - N = n_0 - N_0 \langle 0 |$  (то есть,  $n << N, n_0 << N_0 \rangle$ 

В этом случае процесс отжига после первой стадии приостанавливается, не доходя до конца, а общий процесс термического отжига дефектов будет многостадийным.

Обозначив

$$\Delta m = -\Delta N_{01}$$

где  $\Delta N_{01}$  — концентрации центров данного типа, оставшиеся после первой стадии распада), получим решение кинетического уравнения в следующем виде:

$$N = N_0 \left( \frac{N_0}{\Delta N_{01}} - \left( \frac{N_0}{\Delta N_{01}} - 1 \right) \exp(-4\pi r_0 \beta^{-1} \Delta N_{01} \int_{T_0}^{T} \exp(-\epsilon / kT) dT) \right)^{-1}.$$

Из этого уравнения при  $T \to \infty$  получаем:

$$\exp(-4\pi r_0 \beta^{-1} \Delta N_{01} \int_{T_0}^{T} \exp(-\frac{\varepsilon}{kT}) dT) \to 0$$

и в конце первой стадии имеем:

$$\frac{N}{N_0} = \frac{\Delta N_{01}}{N_0} = \text{const}.$$

То есть процесс термического отжига останавливается не доходя до конца.

Для дальнейшего распада центров окраски данного типа необходимо наличие подвижных дефектов другого типа.

Если концентрации подвижных дефектов второго типа  $n_{02}$  равна концентрации оставшихся центров данного типа

$$N_{02}(n_{02} = \Delta N_{01} = N_{02}),$$

то процесс динамического отжига на второй стадии доходит до конца по реакции II порядка.

Тогда для второй стадии термического отжига имеем:

$$N_{2} = N_{02} \left[ 1 + 4\pi r_{02} \mathcal{A}_{02} N_{02} \int_{T_{0}}^{T} \exp\left(-\frac{\varepsilon_{2}}{kT}\right) dT \right]^{-1}.$$

В этом случае

$$\frac{N}{N_0} = \frac{\Delta N_{01}}{N_0} = \text{const},$$

то есть процесс начинает действовать для оставшейся после первой стадии концентрации центров. Подставим вместо

$$\frac{N}{N_0} = \frac{\Delta N_{01}}{N_0}$$

оставшееся после первой стадии термического отжига его значение, тогда получим следующее:

$$\frac{\Delta N_{01}}{N_0} = \frac{N_{02}}{N_2} = \left[1 + 4\pi r_{02} \prod_{02} \beta^{-1} N_{01} \int_{r_0}^{T} \exp(-\varepsilon / kT) dT\right]^{-1}.$$

Это выражение определяет вторую стадию термического отжига и начинает действовать только на  $\frac{\Delta N_{01}}{N_0}$  .

Тогда двухстадийная кривая термического отжига, происходящая по кинетике II-го порядка имеет следующий вид:

$$\frac{N}{N_0} = \left(\frac{N_0}{\Delta N_{01}} - \left(\frac{N_0}{\Delta N_{01}} - 1\right) \exp(-4\pi r_{01}\beta^{-1} N_{01}\Delta \Pi_{01} \int_{T_0}^T \exp(-\varepsilon / kT) dT)\right)^{-1} \times \left(1 + 4\pi r_{02} \Pi_{02}\beta^{-1} N_{01} \int_{T_0}^T \exp(-\varepsilon / kT) dT\right)^{-1}.$$

Таким образом, исходя из различных соотношений между начальными конценрациями радиационно-наведенных центров и подвижных диффузионных дефектов можно объяснить одностадийных или двух- и более стадийных процессов распада радиационных центров. На основе этой гипотезы получены кинетическое уравнение и его решение для изотермического случая.

#### Список литературы

- 1. Арапов Б., Юнусов М., Арапов Т.Б. Особенности многостадийных процессов тушения свечения центров в ионных кристаллах // Доклады АН РУз. Ташкент, 2002, С. 17–18.
- 2. Арапов Б., Арапов Т.Б. Механизм и кинетика тушения свечения центров в ионных кристаллах. – Бишкек, Илим, 2007. – С.160.
- 3. Арапов Т.Б., Ташкулов К., Арапов Б., Фото- и термостимулированная люминесценция активаторных центров в NaCl-Ag // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. М.: 2016. №4 (часть 5). С.891–893.